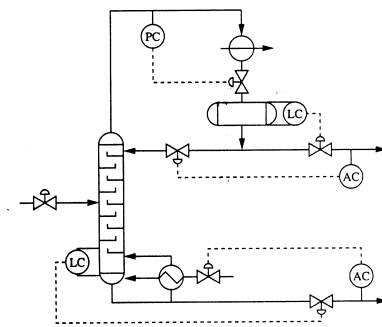


# Multivariable Control System Design



Moonyong Lee

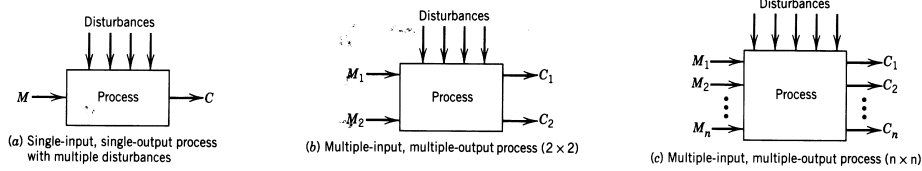
Process Automation & Systems Lab.  
School of Chem. Eng. Tech.  
Yeungnam Univ.

# Contents

1. Basic Concept for MIMO System
2. Control Structure Synthesis
3. Multiloop PID Controller Tuning
4. Decoupling
5. Multiloop Control for Non-Square System
6. Plant Wide Control Configuration
7. Computer Aided MIMO System Analysis

# 1. Basic Concept for MIMO System

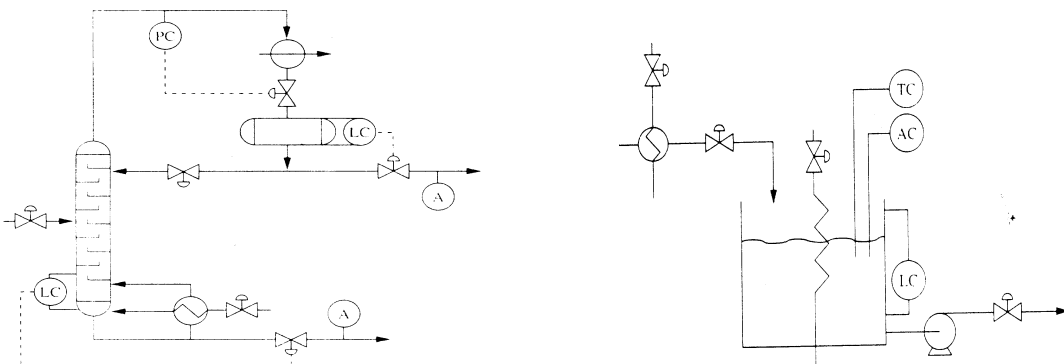
## 1-1. 다변수 공정 (MIMO Process) 개요



- 입출력이 여러개인 공정 → 간섭작용(Process Interaction)

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_{11} & G_{12} & \cdots & G_{1m} \\ G_{21} & G_{22} & \cdots & \vdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ G_{n1} & G_{n2} & \cdots & G_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_m \end{pmatrix}$$

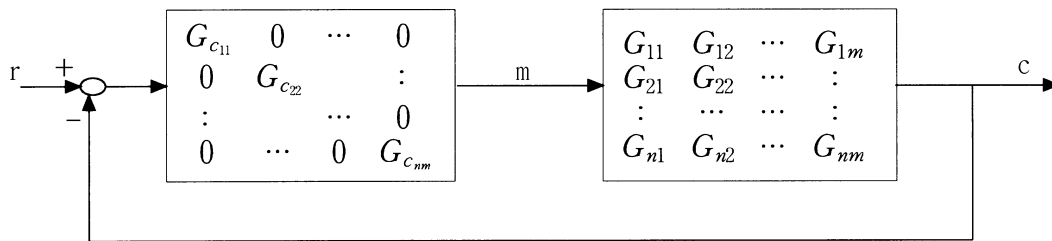
- Main Issues :
  - 제어변수, 조작변수, 측정변수의 최적선정
  - 최적 제어구조 선정
  - 제어 알고리즘 및 Tuning
- 공정 예



## 1-2. 다변수 공정의 제어를 위한 대표적 접근방법

- Centralized Approach v.s. Decentralized Approach

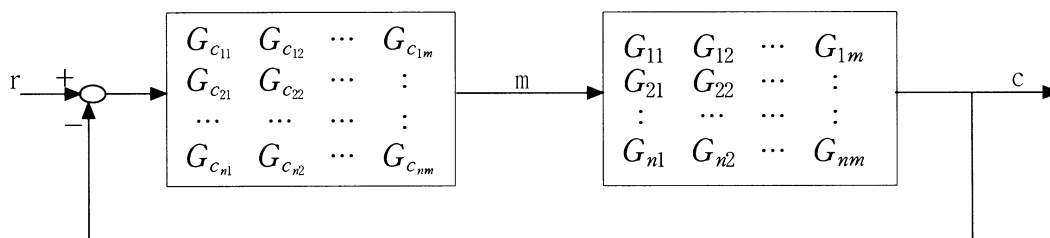
- Decentralized Approach (Multiloop Control)



→ 장점 : 알고리즘 단순, 운전자 이해도 높음  
 제어시스템 유연성, 제어요소 고장에 강건  
 단위공정에 대한 표준설계가 용이

→ 단점 : 제어구조 한정에 의한 제어성능 저하

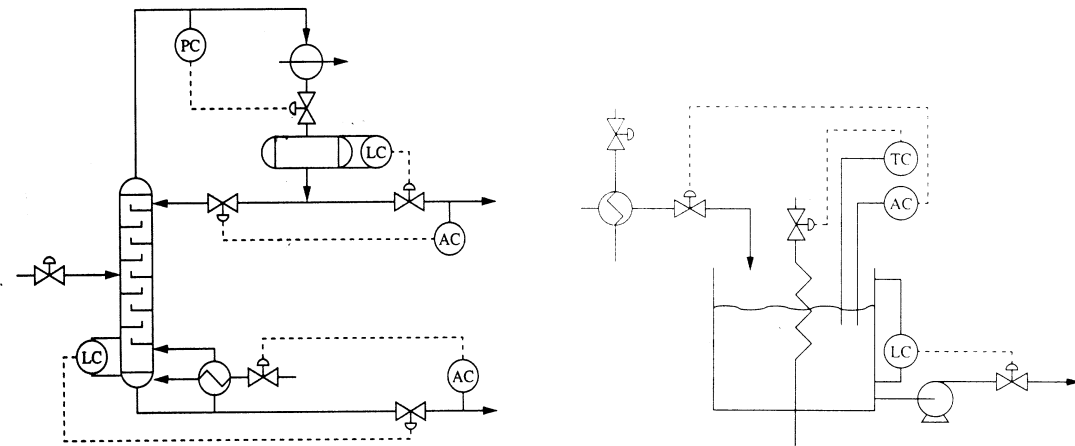
- Centralized Approach (Multivariable Control)



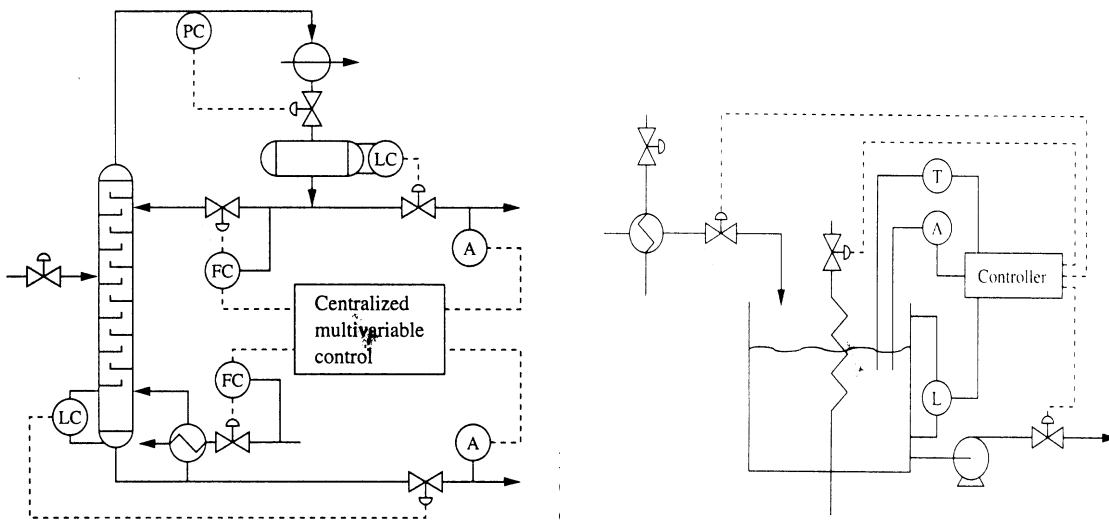
→ MPC, IMC, LQG, LQR ……

• Centralized Approach v.s. Decentralized Approach

- Decentralized Approach (Multiloop Control)



- Centralized Approach (Multivariable Control)



### 1-3. 다변수 제어 시스템에서의 변수 선정

- 제어 변수 선정 : 시스템 자유도 내에서 제어목적을 최대로 만족 하도록 선정



조작 변수 선정 : 제어변수에 보다 직접적이고, 빠르고, 강하며 조작성이 좋은 변수로 선정



측정 변수 선정 : 제어목적의 달성 여부를 직, 간접적으로 파악 할 수 있도록 선정

- 자유도 분석

↙ 독립 변수 갯수

$f = V - E$  ← 시스템 지배 방정식 갯수



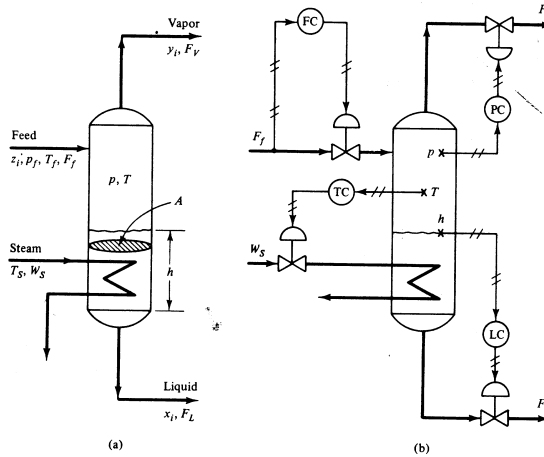
시스템 자유도

- 외부로부터 결정되는 변수, 제어기 설치 등에 의해 시스템 자유도는 추가적으로 줄어들게 됨.

∴ Max No. of C.V. =  $f$  - No. of Externally Specified Inputs.

& No. of M.V. = No. of C.V.

• Flash 공정 예



- Total Eqs (2N+3) : Mass Bal.(N), Heat Bal., Equil. Rel.(N), Cons. Constraints(2)
- Constants (N+7) : A, A<sub>s</sub>, ρ, u, C<sub>pf</sub>, C<sub>ph</sub>, K<sub>i</sub>(N)
- Variables (3N+8) : F<sub>f</sub>, F<sub>v</sub>, F<sub>L</sub>, p, T, h, W<sub>s</sub>, T<sub>f</sub>, x<sub>i</sub>, y<sub>i</sub>, z<sub>i</sub> (3N)

$$\therefore f = (3N+8) - (2N+3) = N+5$$



- T<sub>f</sub>, z<sub>i</sub> (N) 가 외부로 부터 결정되어 오는 경우

$$\text{Max. No. of C.V.} = (N+5) - (N+1) = 4$$



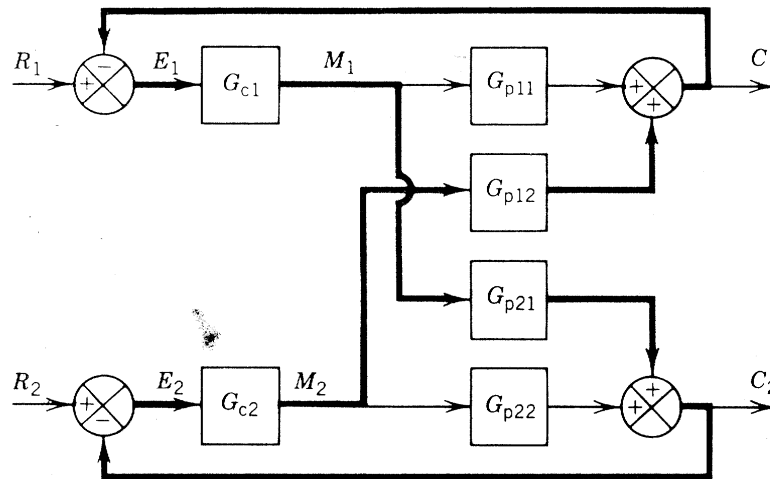
제어변수 : T, P, F<sub>f</sub>, h

조작변수 : F<sub>f</sub>, F<sub>v</sub>, F<sub>L</sub>, W<sub>s</sub>

## 2. Control Structure Synthesis

### 2-1. Process Interaction and Control Loop Interaction

- SISO System과 MIMO System의 제어특성을 다르게 함
- 제어계의 안정성을 저하시키고 Tuning을 어렵게 함
- 2×2 System 예



$$C_1 = \frac{1}{D} [G_{p11} + G_{c1}G_{c2}(G_{p11}G_{p22} - G_{p12}G_{p21})]R_1 + \frac{G_{p12}G_{c2}}{D}R_2$$

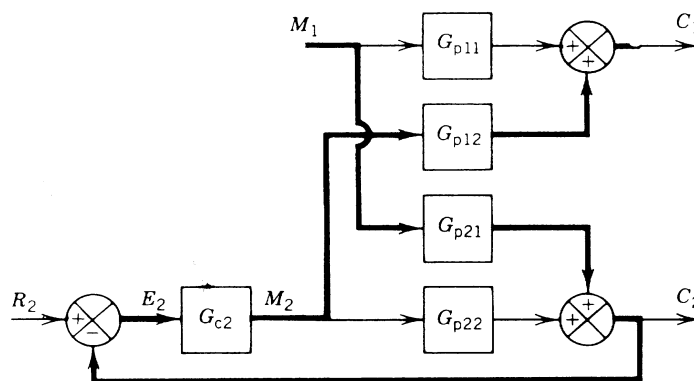
$$\begin{aligned} \text{where } D &= (1 + G_{p11}G_{c1})(1 + G_{p22}G_{c2}) - G_{p12}G_{p21}G_{c1}G_{c2} \\ &= 1 + G_{c1}G_{p11} + G_{c2}G_{p22} + G_{c1}G_{c2}[G_{p11}G_{p22} - G_{p12} - G_{p21}] \end{aligned}$$



## 2-2. Relative Gain Array (RGA)

- Relative Gain : 개루프 이득과 폐루프 이득 간의 비

$$\lambda_{ij} = \frac{(\frac{\partial C_i}{\partial M_j})_{M_{k \neq j}}}{(\frac{\partial C_i}{\partial M_j})_{C_{k \neq i}}}, \quad \lambda_{11} = \frac{G_{b11}(0)}{G_{b11}(0) - \frac{G_{p12}(0)G_{p21}(0)}{G_{p22}(0)}} = \frac{1}{1 - \frac{K_{p12}K_{p21}}{K_{p11}K_{p22}}}$$



값	물리적 의미	pairing
$\lambda_{ij} < 0$	개루프 이득과 폐루프 이득의 부호가 반대 제어기 이득의 부호가 다른 루프 제어기의 모드에 따라 바뀌어야 함.	Dangerous
$\lambda_{ij} = 0$	입력과 출력간에 직접적인 관계가 없음을 의미 다른 루프의 제어기가 Auto 모드인 경우에만 제어 가능 해짐.	Avoid if possible
$0 < \lambda_{ij} < 1$	개루프 이득이 폐루프 이득보다 작음.	Permissible
$\lambda_{ij} = 1$	Interaction 이 없거나 One-Way Interaction 임	Ideal
$\lambda_{ij} > 1$	폐루프 이득이 개루프 이득보다 작음.	Permissible
$\lambda_{ij} = \infty$	다른 루프가 Auto 인 경우 이득이 0 이 되어 제어가 불가능하게 됨.	Impossible

- Relative Gain Array (RGA) → Relative Gain의 행렬

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdots & \lambda_{1n} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \cdots & \vdots \\ \vdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ \lambda_{n1} & \lambda_{n2} & \cdots & \lambda_{nm} \end{bmatrix}$$

$$= G(0) \cdot \{(G(0))^{-1}\}^T \quad \text{where } \cdot \text{ means Hadamard Product}$$

- 각 행 및 각 열의 합은 항상 1
- Scale Independent
- RGA 와 시스템 안정성
  - $\lambda_{ij} < 0$  for  $2 \times 2$  System  $\leftrightarrow$  Unstable
  - $\frac{\text{Det}(G(0))}{\prod G_{ii}(0)} < 0$  for  $n \times n$  System  $\rightarrow$  Unstable (Niderlinski Index)
- RGA 와 Pairing ( $n \times n$  시스템  $\rightarrow n!$  가능한 제어구조 존재)
  - 대각행렬 요소의 값이 음인 경우 제외
  - 0 인 경우는 가급적 피함
  - 양수이고 1 에 가깝도록 Pairing

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.8 \\ 0.8 & 0.2 \end{bmatrix} \quad \rightarrow \quad c_1 - m_2, c_2 - m_1$$

$$A = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.05 & 0.1 & 0.85 \\ 0.15 & 0.8 & 0.05 \end{bmatrix} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{l} c_1 - m_1 \\ c_2 - m_3 \\ c_3 - m_2 \end{array}$$

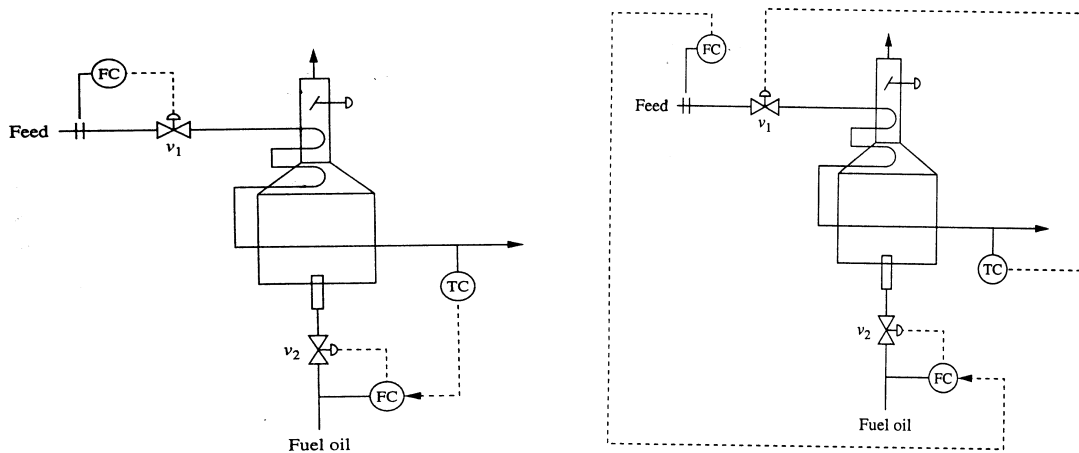
- 모델오차에 매우 민감 → 정확한 이득 사용

실제공정 :  $K = \begin{bmatrix} 1 & 0.949 \\ 0.949 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \Lambda = \begin{bmatrix} 10 & -9 \\ -9 & 10 \end{bmatrix}$

모델 1 ( 3% 오차 ) :  $K' = \begin{bmatrix} 0.97 & 0.977 \\ 0.977 & 0.97 \end{bmatrix} \rightarrow \Lambda = \begin{bmatrix} -7.8 & 8.8 \\ 8.8 & -7.8 \end{bmatrix}$

모델 2 (한요소 오차):  $K' = \begin{bmatrix} 1 & 1.1 \\ 1.0 & 1.0 \end{bmatrix} \rightarrow \Lambda = \begin{bmatrix} 100 & -99 \\ -99 & 100 \end{bmatrix}$

- 중요 제어변수의 경우 Dynamics 영향 고려  
-  $\lambda$ 를 0 으로 Pairing 한 공정 예



$$\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

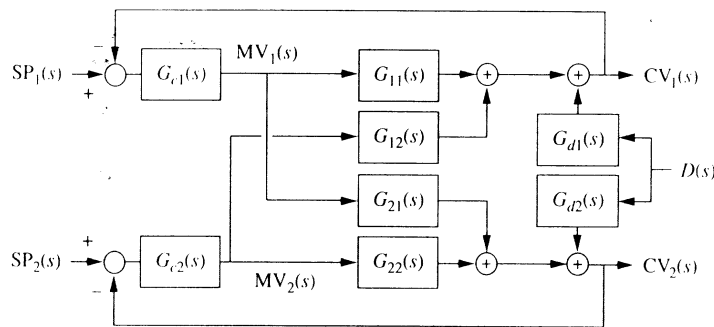
$$\Lambda = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

### 2-3. Relative Disturbance Gain (RDG)

- 외란에 대한 Interaction의 효과를 알 수 있는 Index

$$\beta_i = \frac{\left(\frac{\partial m_i}{\partial d}\right)_{\text{all loops closed}}}{\left(\frac{\partial m_i}{\partial d}\right)_{i \text{ loop closed}}}, \quad 2 \times 2 \text{ 시스템 예: } \beta_1 = \lambda_{11} \left(1 - \frac{K_{d_2} K_{12}}{K_{d_1} K_{22}}\right)$$

- $\beta_i$  가 0 에 가까울수록 외란에 바람직한 Interaction



- 증류탑 예

- Energy balance scheme

$$\begin{pmatrix} Y_D \\ x_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{0.0747e^{-2s}}{12s+1} & -\frac{0.0667e^{-2s}}{15s+1} \\ \frac{0.1173e^{-3.3s}}{11.75s} & -\frac{0.1253e^{-2s}}{10.2s+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R \\ V \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{0.7e^{-5s}}{14.4s+1} \\ \frac{1.3e^{-3s}}{12s+1} \end{pmatrix} x_F$$

$$\lambda_{11} = 6.09, \quad \beta_1 = 0.071$$

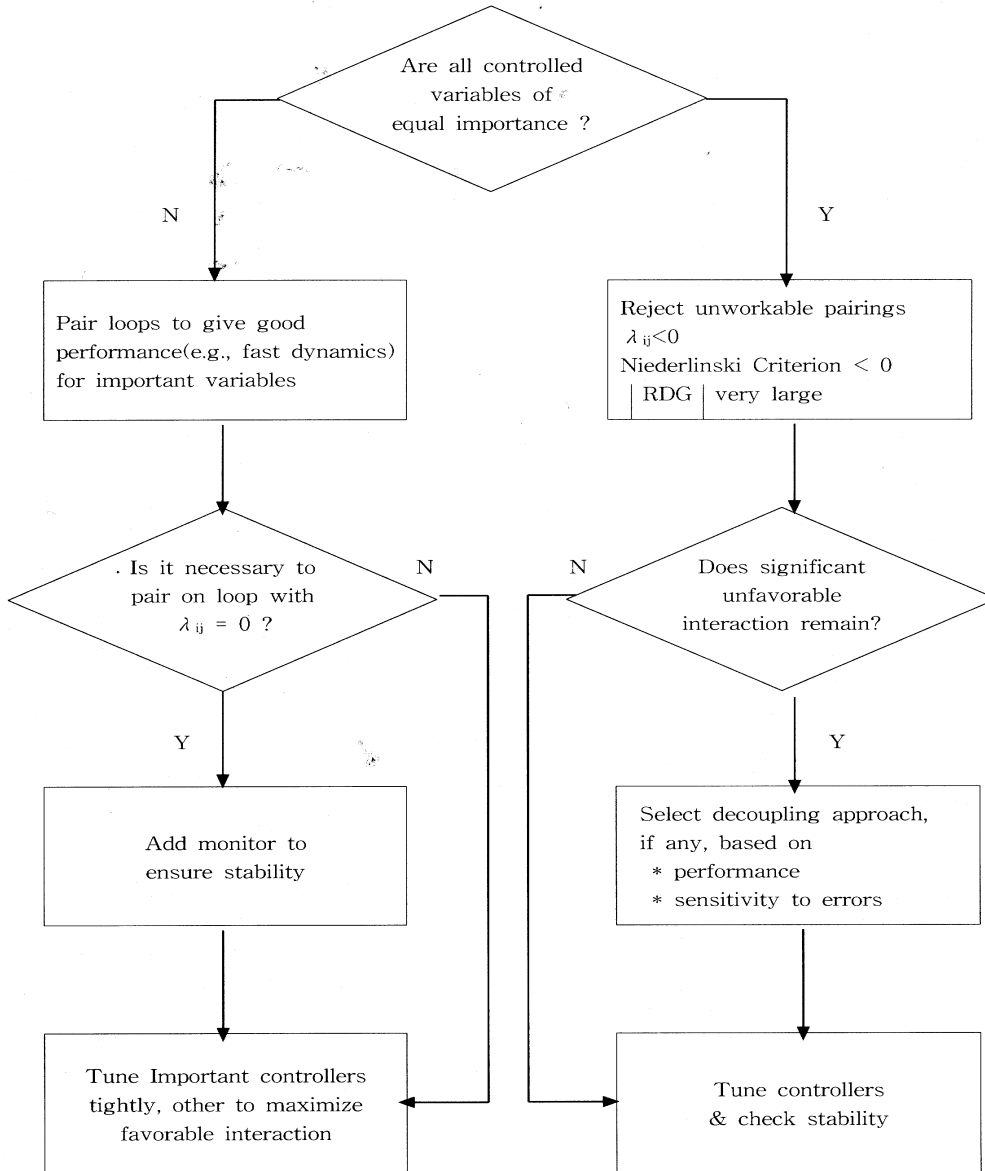
- Material Balance Scheme

$$\begin{pmatrix} Y_D \\ x_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{0.0747e^{-2s}}{10s+1} & -\frac{0.008e^{-2s}}{5s+1} \\ -\frac{0.1173e^{-2s}}{9s+1} & -\frac{0.008e^{-2s}}{3s+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D \\ V \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{0.7e^{-5s}}{14.4s+1} \\ \frac{1.3e^{-3s}}{12s+1} \end{pmatrix} x_F$$

$$\lambda_{11} = 0.39, \quad \beta_1 = 1.11$$

∴ E. B. Scheme 이  $x_F$  의 외란에 대해 M. B. Scheme 보다 좋음

## 2-4. 제어구조선정 및 Tuning Flow Chart



### 3. Multiloop PID Controller Tuning

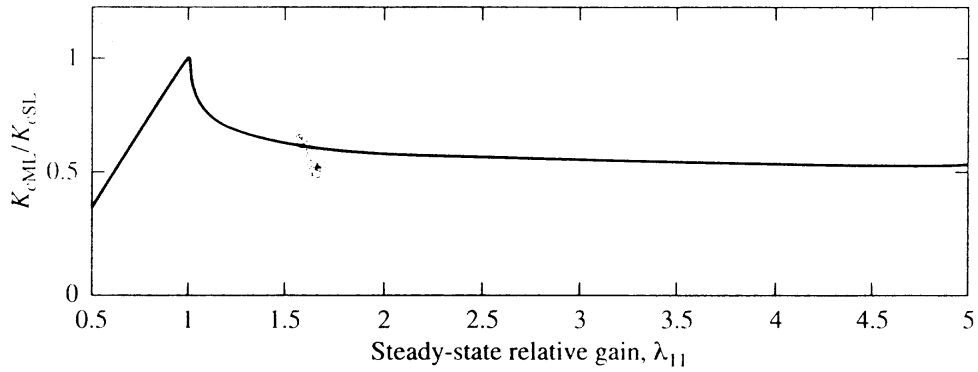
- Interaction Effect 고려 → SISO 시스템의 경우와는 매우 다름
- **일반적 방법** : 중요하지 않은 제어변수 Loop 를 Detuning → 중요한 Loop 를 Single Loop 와 같이 Tuning

#### 3-1. RGA를 이용한 Tuning (2×2 시스템)

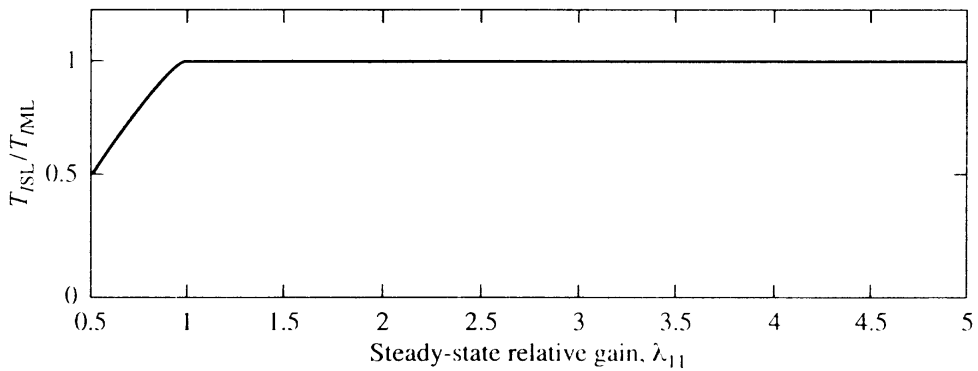
- 페루프 특성방정식  $D=1+G_{c1}G_{11}\left(\frac{1+G_{c2}G_{22}/\lambda_{11}}{1+G_{c2}G_{22}}\right)$
- Loop 1의 Dynamics가 Loop 2 보다 매우 빠른 경우  
 $D \approx 1+G_{c1}G_{11}$  → Interaction이 없는 것과 같이 Tuning
- Loop 1의 Dynamics가 Loop 2 보다 매우 느린 경우  
 $D \approx 1 + \frac{G_{c1}G_{11}}{\lambda_{11}}$  → 제어가 이득이  $\lambda_{11}$  만큼 곱해져서 Tuning
- $\lambda_{11}$  이 1 보다 큰 경우는 시스템 제어성능이 근본적으로 떨어질 수 밖에 없음.

- Loop 1 과 Loop 2 의 Dynamics가 유사한 경우

$$D \approx 1 + 2G_{c1}G_{11} + \frac{(G_{c1}G_{11})^2}{\lambda_{11}}$$



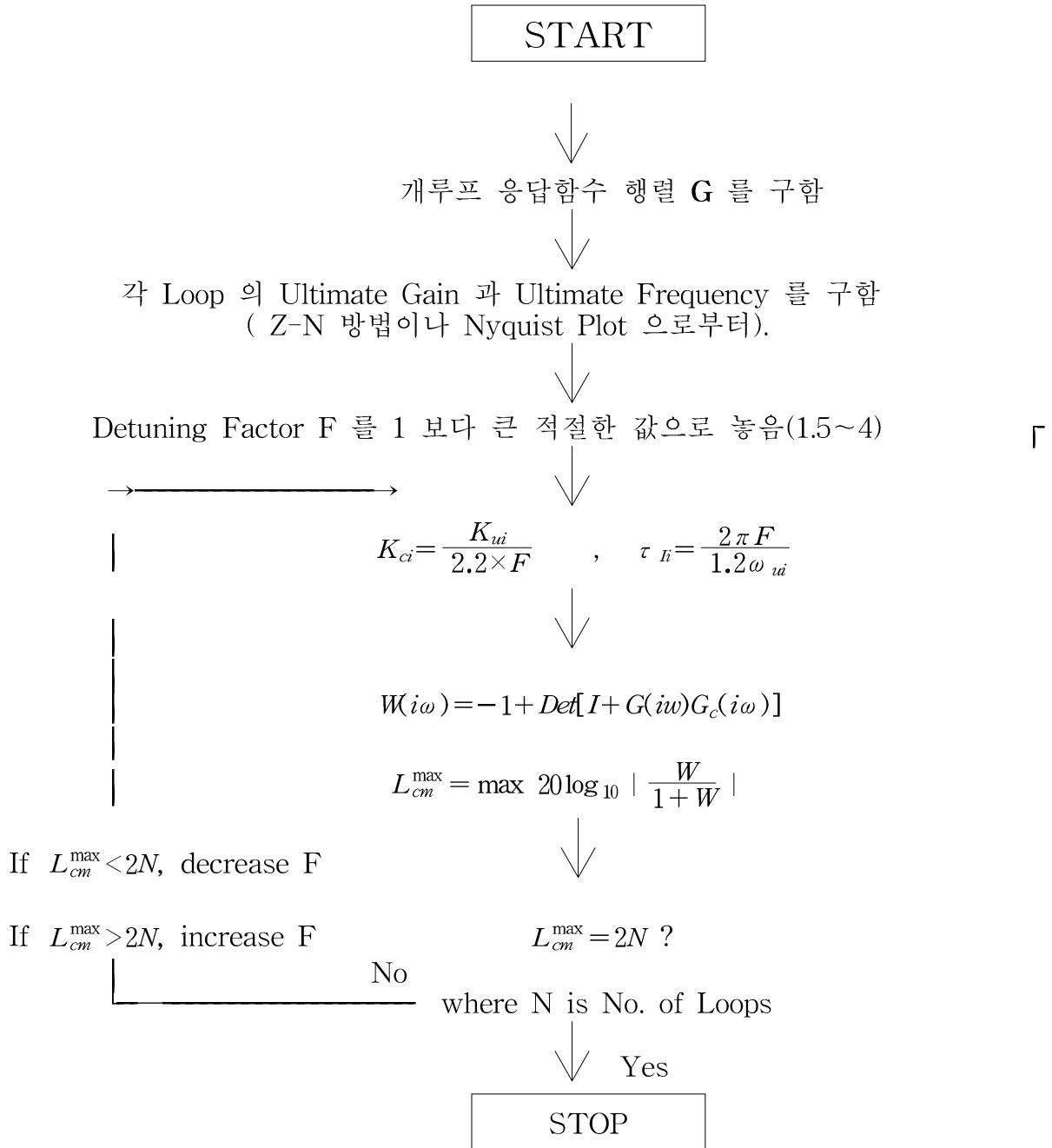
(a)



(b)

- Loop 1 의 안정성이 Loop 2 에 대해서 크게 영향받음  
Detuning이 필요

### 3-2. Biggest Log-modulus Tuning (BLT)





### 3-3. Desired Closed Loop Response (DCLR) 방법

- 각 루프의 페루프 응답이 원하는 응답형태가 되도록 Tuning
  - Robustness 와 Performance 가 좋음
  - Tuning Rule 의 형태가 Explicit 함
- 2×2 MIMO 시스템에서의 Tuning Rule 예.

FOPDT to obtain desired closed-loop response

2×2 Process		$K_C$	$\tau_I$	$\tau_D$
FOPDT	$G = \frac{Ke^{-bs}}{\tau s + 1}$	$\frac{\tau_I}{K(\lambda_1 + \theta_{11})}$	$a - \frac{A(\lambda_1 + \theta_{11}) - \frac{1}{2}\theta_{11}^2 K}{K(\lambda_1 + \theta_{11})}$	$b - \frac{B(\lambda_1 + \theta_{11}) - \frac{1}{2}\theta_{11}^2 A + \frac{1}{6}\theta_{11}^3 K}{\tau_I} - \frac{A(\lambda_1 + \theta_{11}) - \frac{1}{2}\theta_{11}^2 K}{K(\lambda_1 + \theta_{11})}$

where

$$a = \lambda_2 + \tau_{11} + \tau_{21} + \tau_{12}$$

$$b = \lambda_2 \tau_{11} + \tau_{21} \tau_{12} + \lambda_2 \tau_{21} + \lambda_2 \tau_{12} + \tau_{11} \tau_{21} + \tau_{11} \tau_{12}$$

$$K = k_{11} - k_{12} k_{21} / k_{22}$$

$$A = k_{11}(\lambda_2 + \tau_{21} + \tau_{12}) - k_{12} k_{21} / k_{22}(\tau_{11} + \tau_{22} - \theta_{21} - \theta_{12} + \theta_{11})$$

$$B = k_{11}(\lambda_2 \tau_{21} + \tau_{21} \tau_{12} + \tau_{12} \lambda_2) - k_{12} k_{21} / k_{22}(\tau_{11} \tau_{22} + (\tau_{11} + \tau_{22})(\theta_{11} - \theta_{12} - \theta_{21}) + 1/2(\theta_{12} + \theta_{21} - \theta_{11})^2)$$

● SISO 시스템 Tuning Rules

Process	Process Model	Tuning Method	$K_C$	$\tau_I$	$\tau_D$	$\tau_F$
FOPDT Model (PID case)	$G = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1}$	IMC-PID	$\frac{1}{K} \frac{2\tau + \theta}{2\lambda + \theta}$	$\tau + \frac{\theta}{2}$	$\frac{\tau\theta}{2\tau + \theta}$	
		IMC-PID (with Filter)	$\frac{2\tau + \theta}{2K(\lambda + \theta)}$	$\tau + \frac{\theta}{2}$	$\frac{\tau\theta}{2\tau + \theta}$	$\frac{\lambda\theta}{2(\lambda + \theta)}$
		Proposed DCLR	$\frac{\tau_I}{K(\lambda + \theta)}$	$\tau + \frac{\theta^2}{2(\lambda + \theta)}$	$\frac{\theta^2}{6(\lambda + \theta)} \left[ 3 - \frac{\theta}{\tau_I} \right]$	
FOPDT Model (PI case)	$G = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1}$	Smith	$\frac{\tau}{K(\lambda + \theta)}$	$\tau$		
		Improved IMC-PI	$\frac{2\tau + \theta}{2K\lambda}$	$\tau + \frac{\theta}{2}$		
		Proposed DCLR	$\frac{\tau_I}{K(\lambda + \theta)}$	$\tau + \frac{\theta^2}{2(\lambda + \theta)}$		
SOPDT Model (PID case)	$G = \frac{K e^{-\theta s}}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}$	Smith	$\frac{\tau_1 + \tau_2}{K(\lambda + \theta)}$	$\tau_1 + \tau_2$	$\frac{\tau_1 \tau_2}{\tau_1 + \tau_2}$	
		Proposed DCLR	$\frac{\tau_I}{K(\lambda + \theta)}$	$\tau_1 + \tau_2 + \frac{\theta^2}{2(\lambda + \theta)}$	$\frac{\tau_1 \tau_2 - \frac{\theta^3}{6(\lambda + \theta)}}{\tau_I} + \frac{\theta^2}{2(\lambda + \theta)}$	

Note : Desired Closed-Loop Response  $\frac{C}{R} = \frac{e^{-\theta s}}{\lambda s + 1}$

Process	Process Model	$K_C$	$\tau_I$	$D$
Integrating Process 1	$G(s) = \frac{1}{Ks} e^{-\theta s}$	$\frac{1}{K(\lambda + \theta)}$		$\frac{\theta^2}{2(\lambda + \theta)}$
Integrating Process 2	$G(s) = K \frac{1}{s(\tau s + 1)} e^{-\theta s}$	$\frac{1}{K(\lambda + \theta)}$		$\tau + \frac{\theta^2}{2(\lambda + \theta)}$
General SOPDT	$G(s) = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau^2 s^2 + 2\xi\tau s + 1}$	$\frac{\tau_I}{K(\lambda + \theta)}$	$2\xi\tau + \frac{\theta^2}{2(\lambda + \theta)}$	$\frac{\tau^2 - \frac{\theta^3}{6(\lambda + \theta)}}{\tau_I} + \frac{\theta^2}{2(\lambda + \theta)}$
Distributed Parameter Process	$G(s) = \frac{K(\tau_0 s + 1) e^{-\theta s}}{(\tau^2 s^2 + 2\xi\tau s + 1)}$	$\frac{\tau_I}{K(\lambda + \theta)}$	$2\xi\tau - \tau_0 + \frac{\theta^2}{2(\lambda + \theta)}$	$\frac{\tau^2 - \frac{1}{\lambda + \theta} \left( \frac{\theta^3}{6} - \frac{\theta^2 \tau_0}{2} \right)}{\tau_I} - \tau_0 + \frac{\theta^2}{2(\lambda + \theta)}$
Inverse Process 1	$G(s) = \frac{K(-\tau_0 s + 1) e^{-\theta s}}{(\tau s + 1)}$	$\frac{\tau_I}{K(\lambda + \theta + 2\tau_0)}$	$\frac{\tau_0(\theta - \lambda) + \frac{1}{2}\theta^2}{\tau + (\lambda + \theta + 2\tau_0)}$	$\frac{-\frac{1}{\lambda + \theta + 2\tau_0} \left( \frac{\theta^3}{6} + \frac{\theta^2 \tau_0}{2} \right) + \frac{\tau_0(\theta - \lambda) + \frac{1}{2}\theta^2}{\lambda + \theta + 2\tau_0}}{\tau_I}$
Inverse Process 2	$G(s) = \frac{K(-\tau_0 s + 1) e^{-\theta s}}{s(\tau s + 1)}$	$\frac{1}{K(\lambda + \theta + 2\tau_0)}$		$\frac{\tau_0(\theta - \lambda) + \frac{1}{2}\theta^2}{\tau + (\lambda + \theta + 2\tau_0)}$
Inverse Process 3	$G(s) = \frac{K(-\tau_0 s + 1) e^{-\theta s}}{(\tau^2 s^2 + 2\xi\tau s + 1)}$	$\frac{\tau_I}{K(\lambda + \theta + 2\tau_0)}$	$2\xi\tau + \frac{\tau_0(\theta - \lambda) + \frac{1}{2}\theta^2}{(\lambda + \theta + 2\tau_0)}$	$\frac{\tau^2 - \frac{1}{\lambda + \theta + 2\tau_0} \left( \frac{\theta^3}{6} + \frac{\theta^2 \tau_0}{2} \right) + \frac{\tau_0(\theta - \lambda) + \frac{1}{2}\theta^2}{\lambda + \theta + 2\tau_0}}{\tau_I}$

Note: 1. Desired Closed-Loop Response  $\frac{C}{R} = \frac{e^{-\theta s}}{\lambda s + 1}$ ,  $\frac{C}{R} = \frac{(-\tau_0 s + 1) e^{-\theta s}}{(\tau_0 s + 1)(\lambda s + 1)}$  for inverse process.

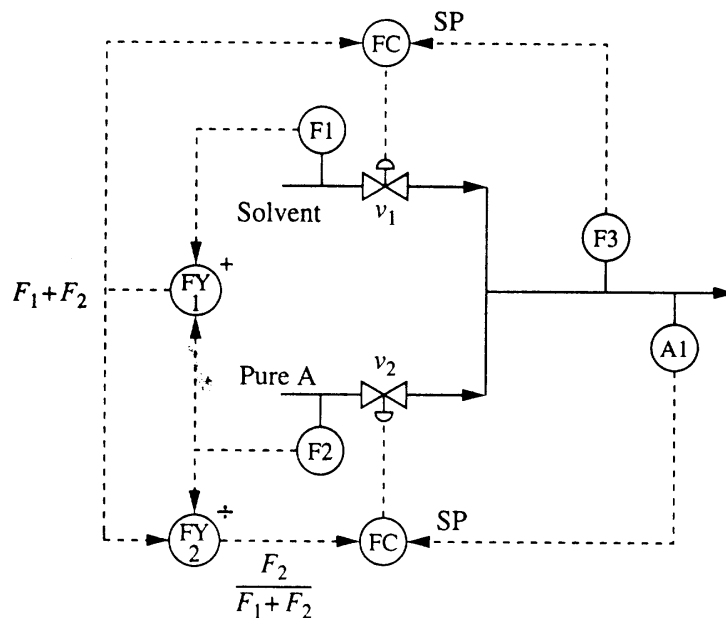
2. If negative derivative or integral time constants are encountered due to strong lead term, determine the tuning parameter using Eq. (20).

## 4. Decoupling

- Unfavorable Interaction 을 Explicit 하게 제거  
① 변수 변환법 ② Decoupler

### 4-1. 변수 변환에 의한 Decoupling

- Blending Control 예

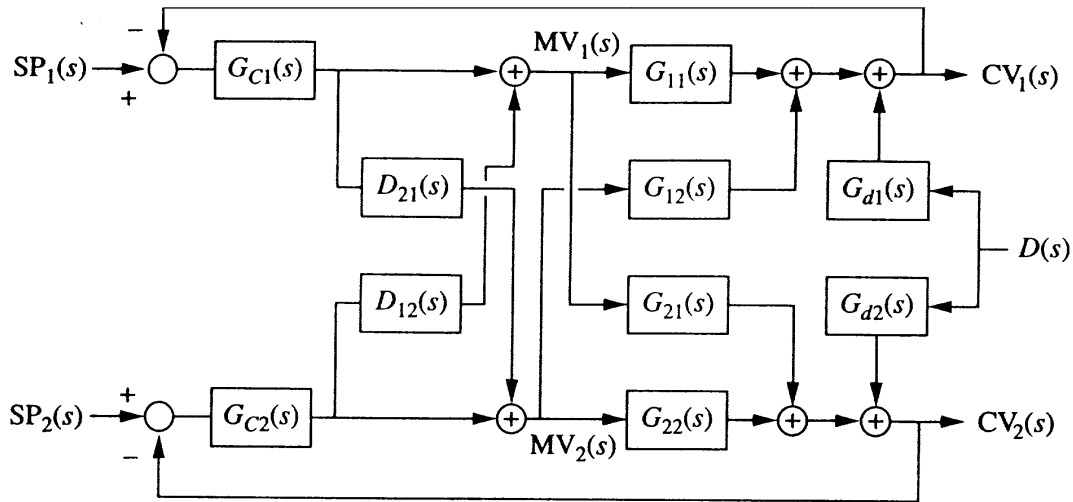


$$- \tau_A \frac{dA_1}{dt} = \left( \frac{F_2(t - \theta_A)}{(F_1(t - \theta_A) + F_2(t - \theta_A))} \right) - A_1(t)$$

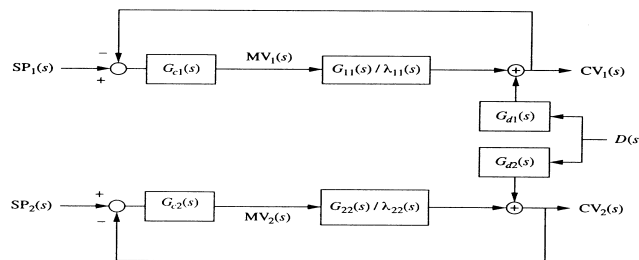
$$\tau_F \frac{dF_3}{dt} = F_1(t - \theta_F) + F_2(t - \theta_F) - F_3(t)$$

$$- F_1, F_2 \text{ (original M.V.)} \rightarrow F_2/(F_1 + F_2), (F_1 + F_2) \text{ (new M.V.)}$$

### 4-2. Explicit Decoupler



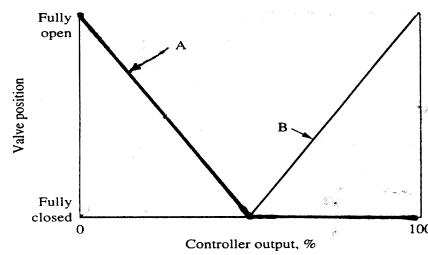
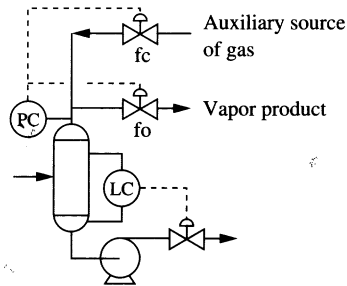
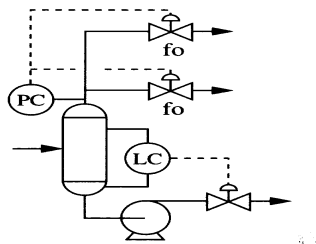
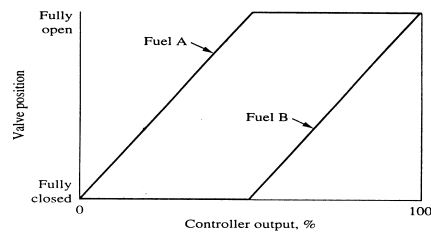
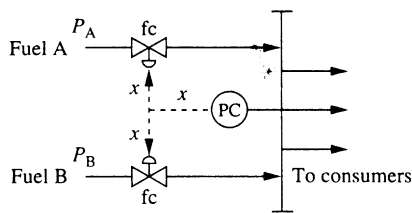
- Dynamic Decoupler  $D_{ij}(s) = -\frac{G_{ij}(s)}{G_{ii}(s)} = -\frac{K_{ij}}{K_{ii}} \frac{\tau_{ii}s+1}{\tau_{ij}s+1} e^{-(\theta_{ij}-\theta_{ii})s}$
- - Compensate Interaction Effect in the Feedforward Manner
  - Too Sensitive to Modeling Error & Saturation
  - Static Decoupler(  $-\frac{K_{ij}}{K_{ii}}$  ) for Similar Dynamics
  - One-Way Decoupler for Robustness ( i.e, one  $D_{ij} = 0$  )
- Effective Process After Decoupling



## 5. Multiloop Control for N-S System

### 5-1. Split Range Control

- No. of M.V. > No. of C.V.



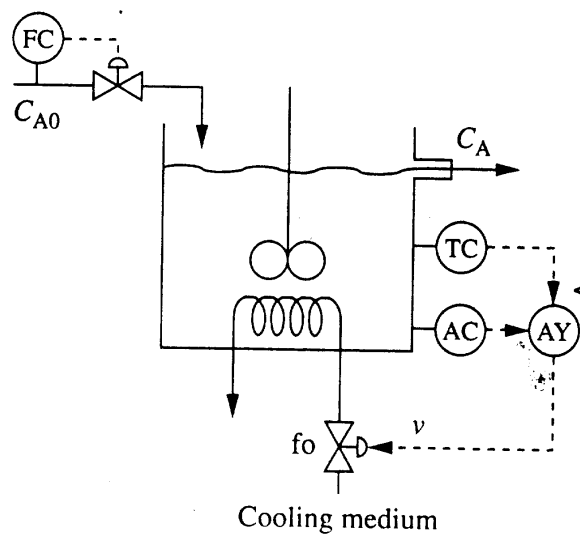
- Main Issues :
  - Detuning or Programmed Tuning for Very Different Dynamics b.t.n. Loops
  - Range Overlap against Dead Zone

## 5-2. Signal Select Control

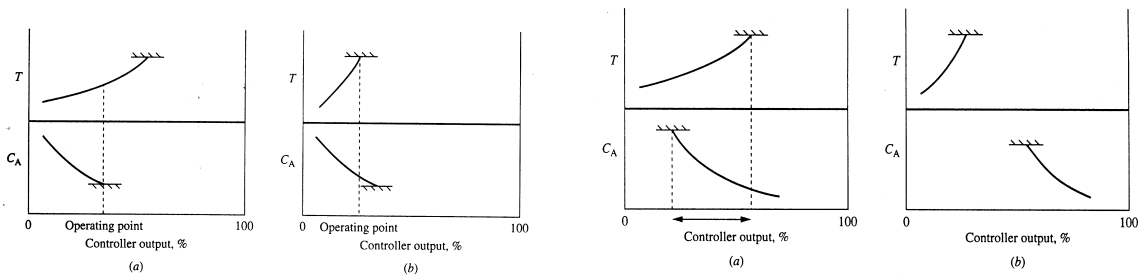
- No. of M.V. < No. of C.V.

- 반응공정 예

- Control Objectives : ① 생산물 농도의 최소 설정점 이상 유지  
② 반응기 온도의 상한점 이하 유지



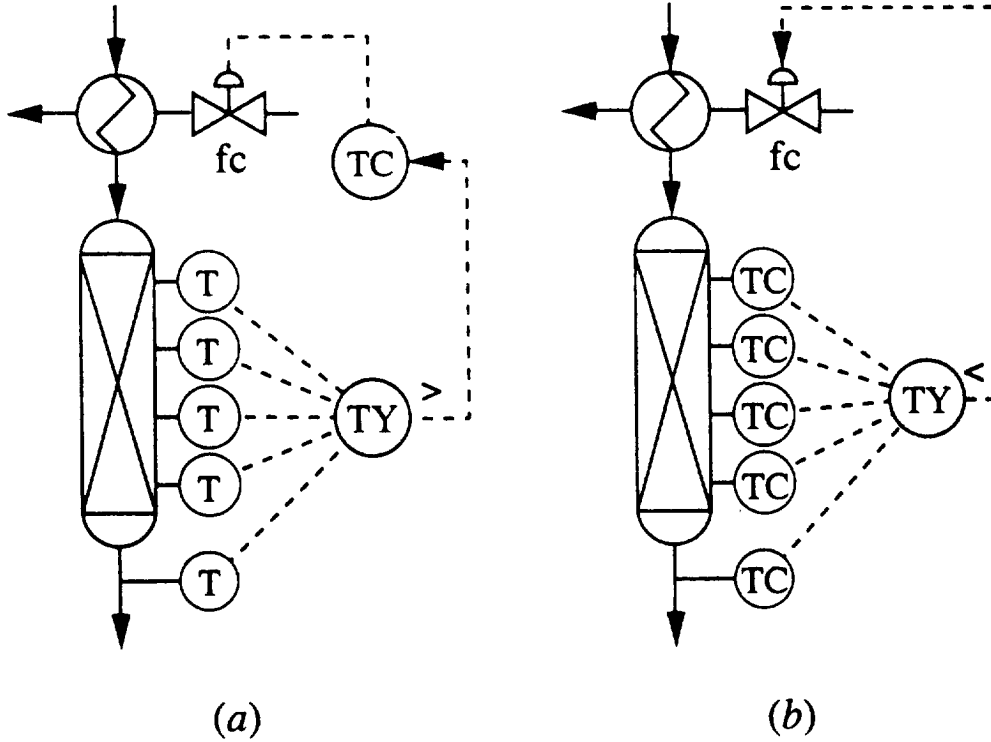
- Feasibility of Signal Select Control → Uniqueness of M.V.



Feasible Case

Infeasible Case

• Measurement Outputs v.s. Controller Outputs

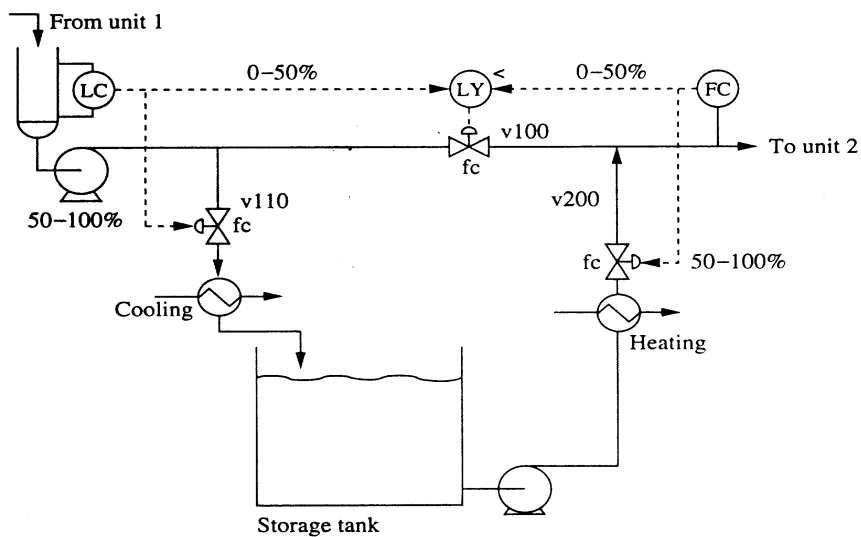


- Measurement Outputs 이용
- 1 개의 제어기만 필요
- Loop Dynamics 가 유사해야 함
- Setpoint가 같아야 함
- 설계 용이.

- Controller Outputs 이용
- 독립된 여러개의 제어기가 필요
- Loop Dynamics가 다를 때 유리
- 독립적 Setpoint 선정가능
- Reset Windup 방지를 위한 Override  
기능 필요 (Override Control)

### 5-3. Constraint Control Using Variable-Structure Methods

- 운전조건을 공정 한계치에 근접하여 운전하고자 할 경우 적용
- Combined Variable-Structure Control 예



- 에너지 절감 최대화를 위해 Unit 1 으로부터 Unit 2 로의 생산물 직접 이송량의 최대화하면서 Smooth 하게 운전
- 각 밸브의 동작 특성

Flow Situation	V 100	V 110	V 200	Net Flow
Unit 1 > Unit2	By FC	By LC	Closed	To storage
Unit 1 < Unit2	By LC	Closed	By FC	From storage

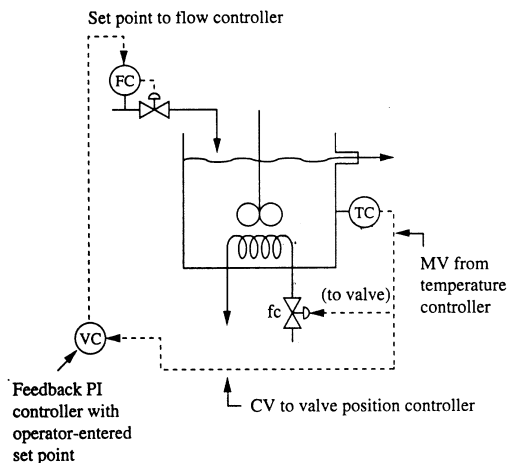


- Valve Position Control

- 한계치 만족을 위하여 Valve Position 을 제어함.
- High-Freq. 외란에 대비하여 실제 한계치보다 적당히 낮게 V.P.C. 의 설정점을 정해주며 Tuning도 충분히 느슨하게 함.
- Relative Gain 이 Zero 인 Pairing 이므로 TC 가 수동모드 상태 일 경우는 반드시 V.P.C. 도 수동모드로 전환해야 함

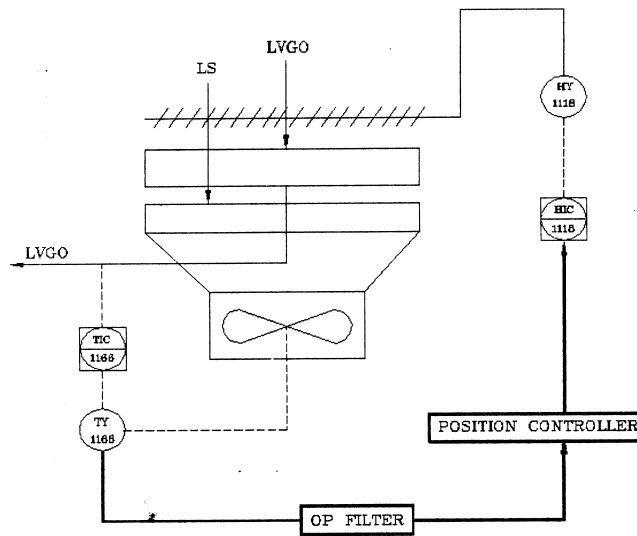
- Valve Position Control 예 1.

- 반응기로의 원료량을 Cooler 한계치 내에서 최대한 하고자 함



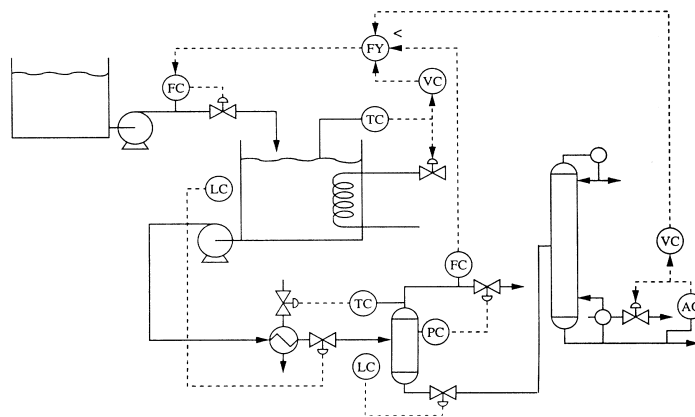
• Valve Position Control 예 2.

- Fan Motor 의 한계치 만족을 위하여 Air Cooler Fan Pitch 각도를 적정 범위내에서 유지하여 운전하고자 함.



• Plantwide Variable-Structure Control 예

- 공정 전체의 주요장치들의 한계치를 동시에 만족하면서 최대 생산량으로 운전

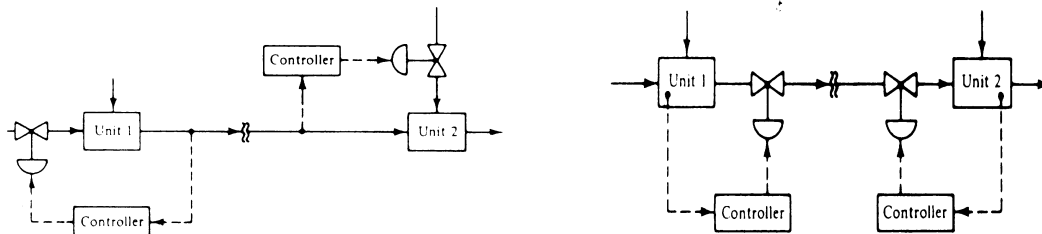


## 6. Plant-Wide Control Configuration

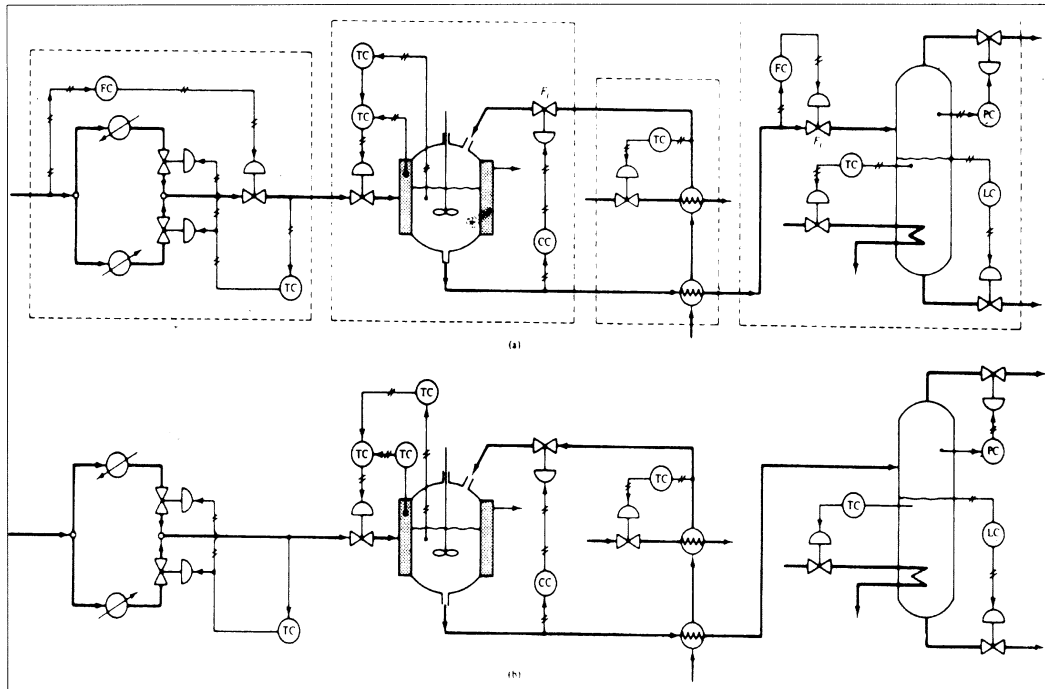
- Modular Approach 에 의한 Configuration Procedure

- ① 전체 공정을 Interaction이 최소화 되는 단위 Block 으로 분해
- ↓
- ② 각 Block에 대한 C.V. 와 M.V. 설정
- ↓
- ③ 각 Block에 대한 Feasible Loop Configuration 결정
- ↓
- ④ 각 Block 간의 Loop Confliction 제거

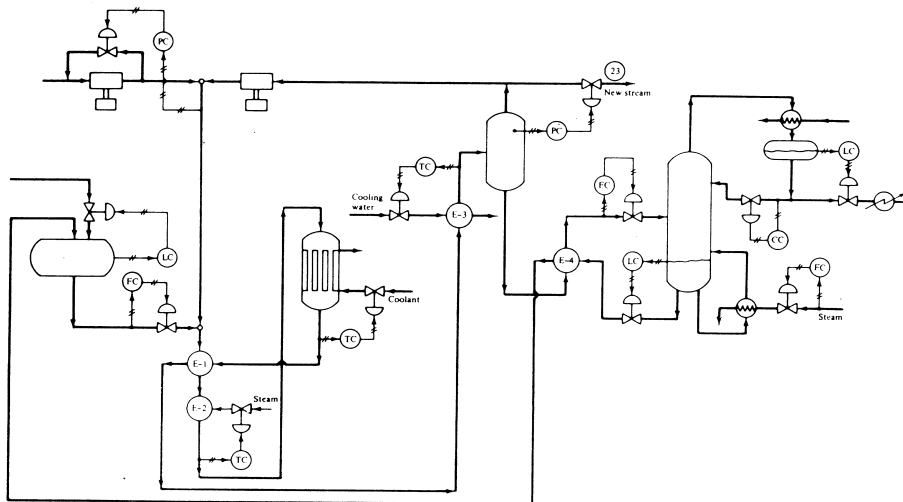
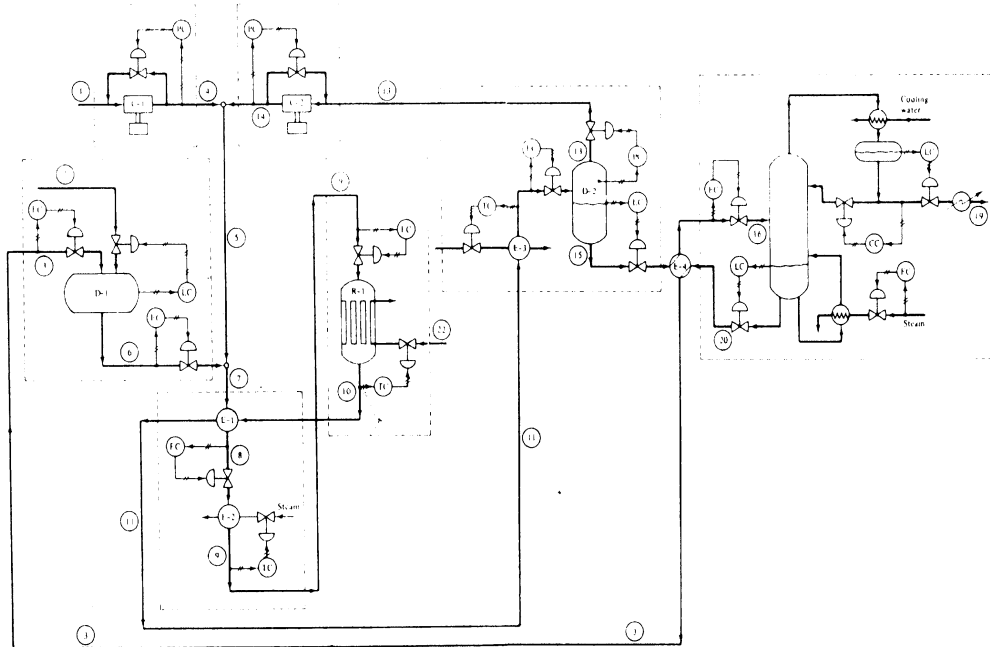
- Loop Confliction의 예



- 반응공정에서의 Configuraton 예



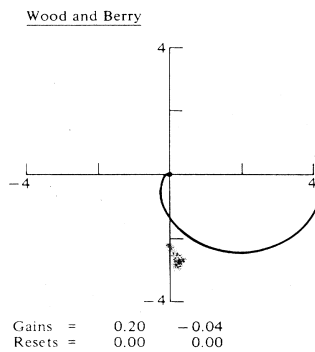
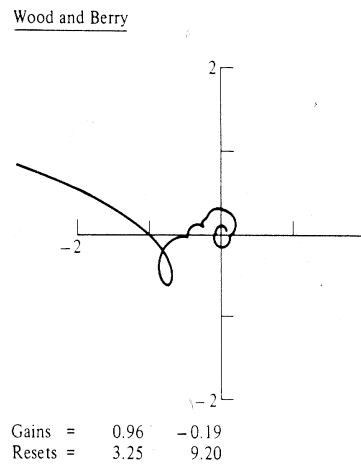
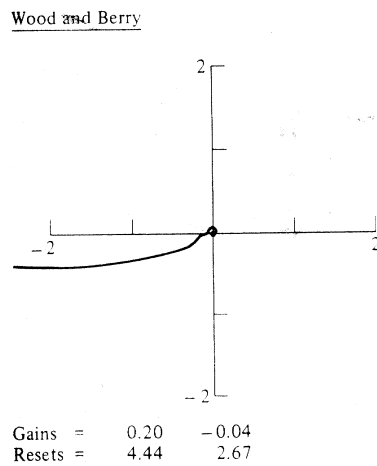
• Recycle 공정에서의 Configuration 예



## 7 Computer Aided MIMO System Analysis

### 7-1. 안정성 분석

- Nyquist 안정성 이론  $\rightarrow W_{(i\omega)} = -1 + \text{Det} [ I + G_p G_c ]$  의 궤적이  $(-1, 0)$  점을 감싸는 횟수는 C.L.S 의 RHP pole 갯수와 같다.
- Wood-Berry Column 예



## 7-2. Resiliency 분석

- **Morari Resiliency Index (MRI)** → 공정 고유의 제어성 정도 추정
  - $MRI = \sigma^{\min}(G_p(i\omega))$
  - MRI 는 Pairing과는 무관하며 값이 클수록 제어성 좋음.
  - MRI 가 0 이면 제어 불가능
    - ① 제어변수간 혹은 조절변수간에 상호 연관성 존재
    - ② 조절변수가 모든 제어변수에 아무런 영향을 주지 않음
    - ③ 제어변수가 모든 조절변수에 대해 영향을 안 받음

## 7-3. Interaction 분석

- **Inverse Nyquist Array (INA)** :
  - $Q = (G_p(i\omega)G_c(i\omega))^{-1}$  의 대각 행렬요소의 궤적
  - 비대각 행렬요소들의 크기의 합을 추가 → Gershgorin Bands
  - Band 의 모든 요소가 (-1, 0) 점을 감싸면 C.L.S 안정성 보장

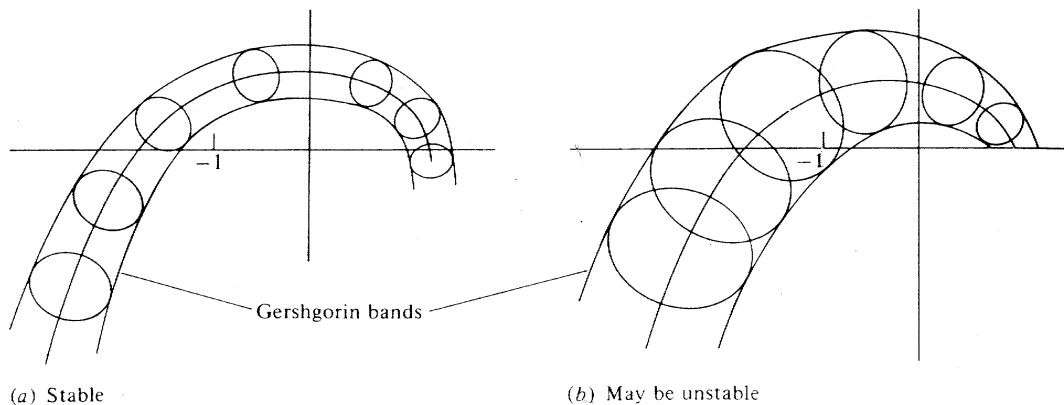
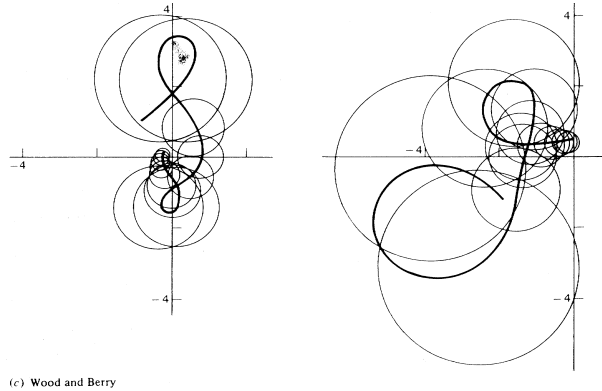


그림 48

- Wood Berry Column 에서의 INA 분석 예



#### 7-4. Doyle-Stein의 Tuning Criteria

- $[I + (G_p G_c)^{-1}]$  의 Minimum Singular Value 가  $-12$  dB 이상이 되도록 각 Loop 의 제어기 조절변수를 조정해 줌.
- Wood-Berry Column 예

